



检测报告

TEST REPORT

报告编号: KDHJ241746

检测类别: 委托检测

项目名称: 废气检测

委托单位: 无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司

KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.

声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国江苏省苏州市苏州工业园区长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	高扬	联系电话	13961774334
采样日期	2024-03-04~2024-03-05、 2024-03-07~2024-03-08、2024-03-11	分析日期	2024-03-04~2024-03-12
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
编制:	丁玉倩		
审核:	封岳		
签发:	孙爱平		
			
	签发日期: 2024 年 04 月 10 日		

表 1-1 固定污染源废气检测结果表（3月4日）

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		16.5	16.6	16.4	/	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		2279	2112	2067	/	/
氨	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	/	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	35	26	30	35	15000
备注	1、排放限值：硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值；氨执行《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 1.0mg/m ³ ，氨的检出限为 0.25mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表（3月4日）

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）	33.5
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		16.3	16.1	16.1	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		2277	1927	2361	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。				

表 1-3 固定污染源废气检测结果表（3月4日）

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		16.0	16.1	16.0	16.0	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		2330	2004	2166	2167	/
氯化氢	排放浓度（mg/m ³ ）	3.43	3.83	3.98	3.75	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	8.1×10 ⁻³	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.7	15.8	15.7	15.7	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		25119	26811	27622	26517	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m ³ ）	0.55	0.32	0.49	0.45	5.0
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.012	/
氯化氢	排放浓度（mg/m ³ ）	3.51	4.06	5.14	4.24	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.11	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.6	15.3	15.0	15.3	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		28632	27573	27533	27913	/
氟化物	排放浓度(mg/m ³)	0.29	0.13	0.28	0.23	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	6.4×10 ⁻³	/
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。				

表 1-6 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度（℃）		15.7	15.7	15.3	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		25119	27622	27573	/	
氯气	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	5.0	
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。				

表 1-7 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		14.6	15.2	15.9	15.2	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		36781	37309	37252	37114	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.98	0.21	0.44	0.54	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.020	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	3.56	3.43	3.73	3.57	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.13	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m ³)	10	9	ND	7	50
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.26	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.2	15.7	15.2	15.4	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		36600	36746	36306	36551	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m ³ （采样体积以 150L 计）。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表（3月5日）

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度（℃）		14.6	15.9	15.2	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		36781	37252	36600	/	
氯气	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	5.0	
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		22.6	22.9	23.1	22.9	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		35541	36039	35655	35745	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.22	ND	0.57	0.30	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.011	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	3.57	2.93	0.63	2.38	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.085	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.4	22.2	22.3	22.3	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		32910	34480	37734	35041	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m ³ （采样体积以 150L 计）。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度（℃）		22.6	23.1	22.4	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		35541	35655	32910	/	
氯气	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	5.0	
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		23.0	23.2	23.5	23.2	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		51349	50410	45968	49242	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	ND	0.34	1.03	0.49	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.024	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	0.90	0.70	0.57	0.72	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.035	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.0	22.8	22.6	22.8	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		50103	48360	47044	48502	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	0.14	0.21	0.09	0.15	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	7.3×10 ⁻³	/
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。				

表 1-15 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度（℃）		23.0	23.0	22.6	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		51349	50103	47044	/	
氯气	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	0.7	0.6	5.0	
	排放速率（kg/h）	/	0.035	0.028	/	
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。				

表 1-16 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		19.5	19.7	19.8	19.7	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		38582	37392	37766	37913	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.64	0.46	0.46	0.52	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.020	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	1.69	0.54	1.27	1.17	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.044	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.0	19.2	19.0	19.1	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		35134	36080	36914	36043	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m ³ （采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表 (3月7日)

点位名称		FQ-003 废气排气筒	排气筒高度 (m)	33.5	
净化设施		碱喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度 (°C)		19.5	19.8	19.2	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		38582	37766	36080	/
氯气	排放浓度(mg/m ³)	0.3	ND	ND	5.0
	排放速率 (kg/h)	0.012	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020) 表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ (采样体积以 5L 计)。				

表 1-19 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.5	19.5	19.5	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		23568	23275	21756	22866	/
硫酸雾	排放浓度（mg/m ³ ）	0.29	0.36	0.31	0.32	5.0
	排放速率（kg/h）	/	/	/	7.3×10 ⁻³	/
氯化氢	排放浓度（mg/m ³ ）	0.71	3.01	1.30	1.67	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.038	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.5	19.5	19.5	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		23706	23928	23627	23754	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	0.30	0.25	0.31	0.29	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	6.9×10 ⁻³	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表（3月7日）

点位名称		FQ-004 废气排气筒	排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		19.5	19.5	19.5	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		23568	21756	23706	/
氯气	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。				

表 1-22 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		26.0	24.4	27.2	25.9	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		46678	46993	48093	47255	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.27	0.26	0.33	0.29	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.014	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	3.43	3.41	3.42	3.42	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.16	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		25.2	25.2	24.6	25.0	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		46412	46061	45259	45911	/
氟化物	排放浓度（mg/m ³ ）	0.18	0.78	1.47	0.81	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.037	/
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。				

表 1-24 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.2	25.2	25.2	25.9	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		48093	46412	46061	46855	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为3mg/m ³ 。				

表 1-25 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-010 废气排气筒	排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		碱喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		26.0	25.2	24.6	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		46678	46412	45259	/
氯气	排放浓度(mg/m ³)	ND	0.4	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	/	0.019	0.018	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为0.2mg/m ³ （采样体积以5L计）。				

表 1-26 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-021 废气排气筒	排气筒高度（m）	25		
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		15.0	15.0	15.0	15.0	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		5617	6353	5453	5808	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	4.22	0.50	6.37	3.70	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.021	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-011 废气排气筒	排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		19.8	20.4	20.6	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		14846	15433	15014	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	0.63	0.35	10
	排放速率（kg/h）	/	9.7×10 ⁻³	5.3×10 ⁻³	/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为0.25mg/m ³ （采样体积以10L计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。				

表 1-28 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-005 废气排气筒	排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		19.9	19.4	20.2	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		15291	16322	16753	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	0.37	0.52	0.88	10
	排放速率（kg/h）	5.7×10 ⁻³	8.5×10 ⁻³	0.015	/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 2、排气筒高度由受检单位提供。				

表 1-29 固定污染源废气检测结果表（3月8日）

点位名称		FQ-006 废气排气筒	排气筒高度 (m)	33.5	
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度 (°C)		19.8	20.2	20.8	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		15652	16003	15314	/
氨	排放浓度(mg/m ³)	0.76	ND	0.63	10
	排放速率 (kg/h)	0.012	/	9.6×10 ⁻³	/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m ³ （采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。				

表 1-30 固定污染源废气检测结果表（3 月 11 日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		19.1	19.9	21.1	20.0	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		24599	25294	25526	25140	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.66	1.10	0.31	0.69	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.017	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	0.74	0.70	0.72	0.72	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.018	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表（3月11日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		20.7	21.3	21.6	21.2	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		25918	25333	24537	25263	/
氟化物	排放浓度(mg/m ³)	0.46	0.44	0.54	0.48	1.5
	排放速率（kg/h）	/	/	/	0.012	/
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。				

表 1-32 固定污染源废气检测结果表（3月11日）

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度（℃）		19.1	21.1	21.3	/	
标态烟气量（Nm ³ /h）		24599	25526	25333	/	
氯气	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	5.0	
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	
备注		1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ （采样体积以 5L 计）。				

表 1-33 固定污染源废气检测结果表（3 月 11 日）

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		21.9	22.4	22.4	22.2	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25312	25556	25546	25471	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m ³)	0.31	0.78	0.30	0.46	5.0
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.012	/
氯化氢	排放浓度(mg/m ³)	0.79	1.34	1.52	1.22	10
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	0.031	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m ³ 。					

表 1-34 固定污染源废气检测结果表 (3月11日)

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度 (°C)		21.7	21.7	21.8	21.7	/
标态烟气量 (Nm ³ /h)		24336	24889	26644	25290	/
氟化物	排放浓度(mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表3限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m ³ (采样体积以 150L 计)。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表 (3月11日)

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度 (m)		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值	
烟气温度 (°C)		21.9	22.4	21.8	/	
标态烟气量 (Nm ³ /h)		25312	25546	26644	/	
氯气	排放浓度(mg/m ³)	ND	0.3	ND	5.0	
	排放速率 (kg/h)	/	7.7×10 ⁻³	/	/	
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)表3限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m ³ (采样体积以 5L 计)。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表（3月11日）

点位名称		FQ-016 废气排气筒	排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		15.1	15.3	14.1	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		22670	20764	20438	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/
备注		1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为0.25mg/m ³ （采样体积以10L计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。			

表 1-37 固定污染源废气检测结果表（3月11日）

点位名称		FQ-017 废气排气筒	排气筒高度（m）	33.5	
净化设施		酸喷淋			
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	排放限值
烟气温度（℃）		14.5	14.9	14.6	/
标态烟气量（Nm ³ /h）		21469	21380	22119	/
氨	排放浓度（mg/m ³ ）	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/
备注		1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表3限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为0.25mg/m ³ （采样体积以10L计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。			

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》（GB/T 14678-1993）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
X-015-90、X-015-93	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H-C
F-001-14、F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
X-016-30	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-39、X-016-44、X-016-41、 X-016-40、X-016-43	全自动烟气采样器	MH3001
F-010-06、F-010-08	离子色谱仪	883
F-014-13	离子计	PXSJ-216F
X-015-60、X-015-52、X-015-19、 X-015-08	自动烟尘(气) 测试仪	崂应 3012H
X-015-77	烟气综合分析仪	崂应 3022
X-060-72	充电便携采气桶	labtm009
F-002-24	气相色谱仪	GC-2030

*****报告结束*****